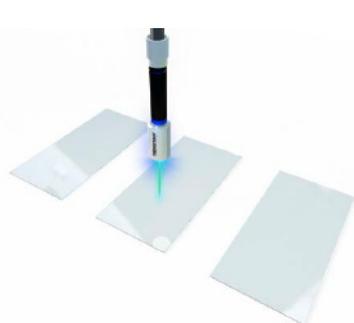
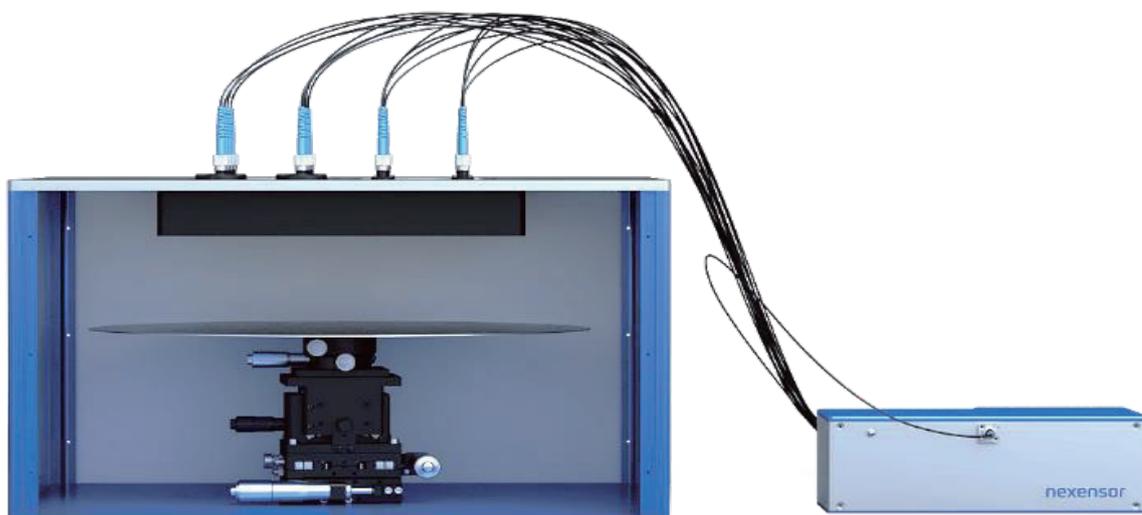


nXV-1

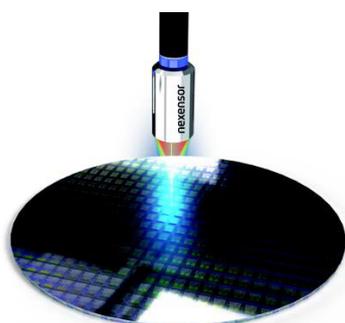
nexensor

近赤外干渉式厚み・変位センサ

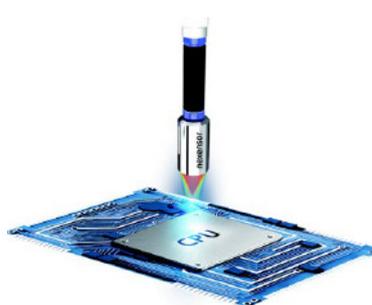
正確な変位と厚さの測定／光量調整可能で不透明膜にも対応



Film & Glass



Wafer



Conformal Coating



Secondary Battery Sealing

- 正確な変位と厚さの測定
- 光量調整可能で不透明膜にも対応
- オンラインで使える高速リアルタイム計測
- 二次電池のシリング厚さ、PC コンフォーマルコーティング厚さなど
- 最大 16 チャンネル

Nexensor 社の nXV-1 は最大 16 チャンネルのプローブで正確な計測ができる干渉厚み・変位センサです。

コーティングのある表面も精度よく測定でき、光量調整可能で不透明膜にも対応。

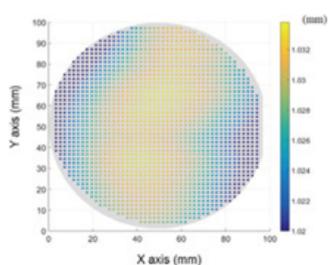
測定に利用する光源の波長を変えることで、透明な物体（フィルム、ガラス、石英など）やシリコンウェハも測定でき、また PCB コンフォーマルコーティングや 2 次電池の封止厚さなど計測の難しい対象も測定できます。

仕様

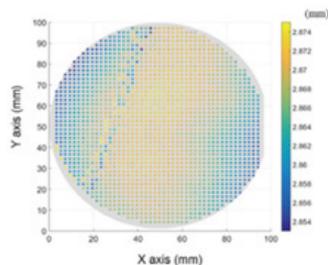
※お客様サンプルのデモ測定をご希望の場合はお気軽にご相談ください。

プローブ	スキャンタイプ		スポットスキャン	
	タイプ	T	C	
サイズ	Φ15	Φ33	Φ56	Φ21
WD	74mm	70mm	25mm	27mm
測定レンジ (厚さ)	0.05 ~ 4 mm		0.05 ~ 1 mm	
最大レンジ (変位)	—		1 mm	
スポットサイズ	100μm	7 μm	7 μm	21.6μm
繰返精度	1 nm			
光源波長	1050nm			
光源強さ	60mW			
計測時間シングル	7 ms			
計測時間マルチ	70ms			
動作環境温度	0 ~ 35°C			
動作環境湿度	20 ~ 85%RH			

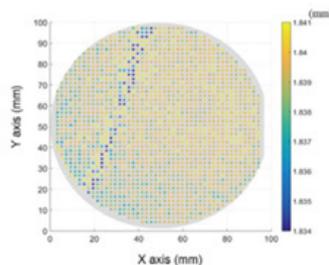
コントローラー	プローブ数	1 / 4 / 8 / 16
	PCインターフェース	イーサネット
	標準消費電力	5V 4A
	動作環境温度	0 ~ 45°C
	動作環境湿度	35 ~ 85%RH



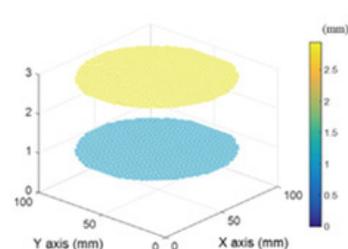
Top surface



Bottom surface



Thickness surface



Wafer Profiles